



YAMAGUCHI INTERNATIONAL PATENT OFFICE

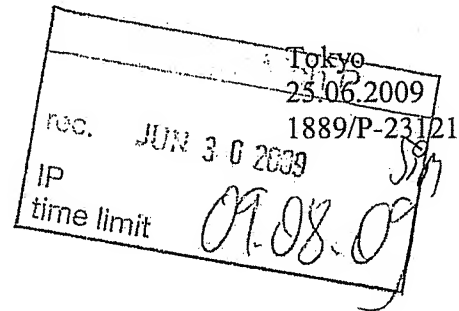
Taisei Bldg.8F, Higashi-Gotanda 2-3-2, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0022 JAPAN

Tel: (+81)3-5475-6446 Fax: (+81)3-5475-6447 or (+81)3-5475-6719

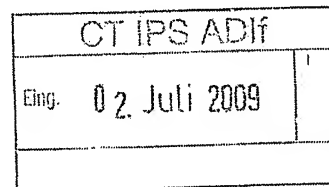
E-mail address: office@yamapat.jp

Patent Attorneys: I. YAMAGUCHI, Y. KOMADA and K. MATSUZAKI

Siemens AG
CT IP S AE
Postfach 221634
D-80506 München
Deutschland



Ihr Zeichen 2003P17896WOJP
Japanische Patentanmeldung 2006-550109



Sehr geehrte Damen und Herren,

in dieser Sache haben wir von der Prüfungsstelle einen ersten Prüfungsbescheid vom 3.6.2009 (abgesandt am 9.6.2009) erhalten.

Eine Kopie dieses Prüfungsbescheides fügen wir zusammen mit dessen vollständiger englischer Übersetzung und Kopien der Entgegenhaltungen mit korrespondierenden Druckschriften bzw. teilweisen Übersetzungen bei.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns Ihre diesbezüglichen Informationen noch rechtzeitig zur Verfügung stellen könnten, da dieser Bescheid spätestens bis zum 9.9.2009 schriftlich bei der Prüfungsstelle beantwortet werden muß.

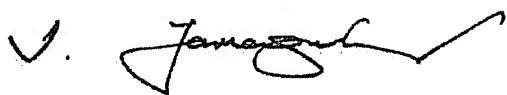
Bezüglich dieses Bescheides möchten wir Sie noch auf Folgendes hinweisen:

- 1) Die jetzt geltenden Patentansprüche 1 - 14 der japanischen Anmeldung entsprechen im wesentlichen denen von 1 - 14 der ursprünglichen PCT-Fassung.
- 2) Berichtigungen der Patentansprüche sowie der Beschreibungsteile sind nur gleichzeitig mit der Bescheidserledigung zulässig, und zwar nur im Rahmen des in den ursprünglichen Unterlagen offenbarten Anmeldungsgegenstandes.
- 3) Die Frist zur Erledigung des Bescheides kann auf Antrag (gebührenpflichtig) noch um einen Monat, maximal um 3 Monate, d.h. im vorliegenden Falle bis zum 9.12.2009,

verlängert werden. Falls wir von Ihnen bis zur obengenannten Frist keine Informationen bzw. Anweisungen erhalten, werden wir sicherheitshalber die Fristverlängerung je um einen Monat beantragen.

Ihrer rechtzeitigen Rückäußerung sehen wir gerne entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iwao Yamaguchi', with a checkmark to its left.

Iwao Yamaguchi

IY/tf

Anlagen

Kopie des Bescheides mit Übersetzung

Kopie der Entgegenhaltungen mit korrespondierenden Druckschriftent bzw. teilweisen Übersetzungen

Reference No.: P-23121

Dispatch No.: 363796

Dispatch Date: June 9, 2009

NOTIFICATION OF REASON FOR REFUSAL

Patent Application No.	2006-550199
Drafting Date	June 3, 2009
Examiner of Patent Office	Shigeo Takami 9116 2J00
Representative / Applicant	Mr. Iwao Yamaguchi
Applied Provision	Section 29(2)

This application should be refused for the reasons mentioned below. If the applicant has any argument against the reasons, a written argument must be submitted within 3 months from the dispatch date of this notification.

REASON

The inventions according to the claims 1-14 as indicated below in the subject application should not be granted a patent under the provision of Patent Law Section 29(2), since these could have easily been made by anybody having ordinary knowledge in the technical field to which the inventions pertain, based on the inventions that were described in distributed publications listed below, or the inventions that were made publicly available through an electric telecommunication line, in Japan or a foreign country, prior to the filing of the subject application.

Note

1. JP-T-11-513801 (corresponding to WO 97/14939)
2. JP-A-2002-303103 ([0037] to [0041], fig 3, fig 4)
3. JP-A-2-171618 (line 5 in right lower column of Page 3 to line 6 in left lower column of page 4, fig 2) (column 3 line 37 to column 4 line 34 of the corresponding USP 4914953)
4. JP-A-63-304120 (line 14 in right upper column of page 4 to line 7 in right lower column of page 5, Fig 1, Fig 8)
5. JP-A-2000-321206 ([0017], fig 1) (line 9 to line 17, page 9 of the corresponding WO 00/68668)
6. JP-A-2002-71565 ([0029])

Cited document 4 describes a method of detecting vibrations of a rotating impeller of a turbine, including: a step of preparing a substance that emits photons due to external excitation, on an impeller rotor of the turbine; a step of illuminating a radiation ray to the rotating impeller rotor and the substance arranged thereon by means of a radiation-ray source for external excitation; a step of detecting photons radiated from the substance by means of a sensor; and a step of evaluating an output signal of the sensor and detecting a vibration behavior of the impeller rotor. In the methods of detecting vibrations of an impeller described in cited documents 1 - 3, it can be properly achieved by the person skilled in the art to use the measurement technique described

in cited document 4.

Therefore, if considered in light of the technical common knowledge at the filing of the application described in cited documents 5 and 6, the inventions in claims 1 - 14 of the present application can be easily reached by the person skilled in the art on the basis of the inventions described in cited documents 1 - 4.

